

반도체 침지 세정용 맞춤형 Ptfе 사각 탱크 내산성 불소수지 여과 용기

품목 번호: PL-CP53



소개

뛰어난 내산성과 미량 분석 순도로 설계된 맞춤형 PTFE 사각 탱크로 반도체 제조 공정 효율을 극대화하세요. 이 고성능 불소수지 용기는 까다로운 연구실 및 산업 공정에서 오염물질 없는 침지 처리와 안정적인 화학물질 취급을 보장합니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
반도체 웨이퍼 에칭	표면 개질 및 오염물 제거를 위해 실리콘 웨이퍼를 농축 산조에 침지하는 공정	금속 이온 오염을 방지하고 강한 HF/HNO3 혼합물에 대한 내성을 갖춘
태양 전지 제조 공정	대규모 태양광 제조 라인에서 실리콘 기관의 텍스처링 및 세정 공정	대량 생산에 적합한 내구성과 알칼리 에칭 용액에 대한 내성
미량 분석 시료 전처리	오염 제로 기준선을 확보하기 위해 연구실 실험기구를 산 분해 및 침지 처리하는 공정	PPT 수준 검출 한계에 필수적인 초저 용출 프로파일
귀금속 회수	왕수 또는 시안화물 용액에서 금속을 용해하기 위한 반응 또는 침지 용기로 사용	산화 공격에 완전한 내성과 고온 안정성
항공우주 부품 세정	부식성 화학 약품을 사용하여 고정밀 엔진 부품의 탈지 및 스케일 제거 공정	고부하 사이클이 요구되는 가혹한 산업 환경에서 장기적인 안정성
제약 화학 합성	고순도 의약품 제조에서 부식성 시약을 취급하는 주 용기로 사용	논스틱 표면으로 FDA 규정 준수 및 멸균이 용이
배터리 연구 및 테스트	가속 노화 및 성능 테스트를 위해 전극 소재를 전해질 용액에 침지하는 공정	다양한 리튬염 및 유기 탄산염과 화학적 호환성
마이크로일렉트로닉스 포토레지스트 박리	고온에서 특수 용매 블렌드를 사용하여 기관에서 유기 코팅을 제거하는 공정	열 응력과 용매 노출 환경에서도 구조적 무결성을 유지

매개변수	PL-CP53 사양
기본 소재	100% 버진 고밀도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
옵션 소재	투명도 또는 화학 순도 향상을 위한 PFA(과불소알콕시알칸)
치수 (가로 x 세로 x 높이)	완전 맞춤화 가능 (고객 작업 공간 및 배치 크기에 맞춤 제작)
벽 두께 범위	맞춤화 가능 (용량에 따라 표준 5mm ~ 30mm 이상)
작동 온도 범위	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
화학적 호환성	전 범위 호환 (용용 알칼리 금속 및 특정 불소화제 제외)
제작 방식	5축 CNC 가공 / 고정밀 용접 (필요에 따라)
내부 기능	맞춤형 배플, 필터 슬롯, 계단식 지지대
배수 시스템	옵션으로 통합 PTFE 볼 밸브 또는 NPT 나사 포트 제공
리드 구성	루즈핏, 플트 온, 힌지형 PTFE 커버 중 선택 가능
표면 마감	가공으로 매끄럽게 처리 (요청 시 Ra < 0.8 µm 가능)
적재 용량	특정 소재 밀도와 용량에 맞춰 설계